

研究紹介

単色 X 線およびデュアル X 線の
簡便な発生法と計測機器への応用

技術解説

E C R スパッタ法による薄膜作成

設備紹介

最新の疲労試験方法

—超音波振動を利用した疲労試験装置—

産技研、F P G A カンファレンスを共催

蛍光タンパク質を用いた非特異的吸着の評価



西が丘本部でデザインセンターオープニングセレモニー
が行われました(平成18年9月13日)

本誌はインターネットでも閲覧できます。 <http://www.iri-tokyo.jp> をご覧ください。



地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター